(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-39915 (P2002-39915A)

(43)公開日 平成14年2月6日(2002.2.6)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			7	-7]-ド(参考)
G 0 1 M	11/02			G 0 1	M 11/02		В	2G086
G 0 2 B	7/28			G 0 2	B 13/00			2H051
	13/00			G 1 1	B 7/09		В	2H087
G 1 1 B	7/09				7/135		Z	5 D O 7 5
	7/135				11/105		551B	5D118
			審査請求	有	請求項の数 7	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特願2001-151812(P2001-151812)

(62)分割の表示

特願平10-349072の分割

(22)出願日

平成10年12月8日(1998.12.8)

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 吉田 慎也

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74)代理人 100102277

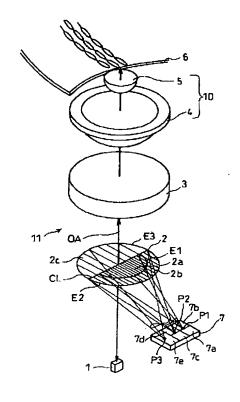
弁理士 佐々木 晴康 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 検出装置及び光ピックアップ装置

(57)【要約】

【課題】 周囲の電気的なノイズに影響されることなく、集光光学系に生じる球面収差を精度良く検出する。 【解決手段】 集光光学系を通過した光ビームを、前記光ビームの光軸に近い側の第1の光ビームと、前記第1の光ビームよりも外側の第2の光ビームとに分離する分離手段と、前記分離手段により分離された第1および第2の光ビームをそれぞれ独立して受光する受光手段と、前記受光手段の出力に基づいて、前記集光光学系の焦点誤差並びに球面収差を検出する検出手段とを具備する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 集光光学系を通過した光ビームを、前記 光ビームの光軸に近い側の第1の光ビームと、前記第1 の光ビームよりも外側の第2の光ビームとに分離する分 離手段と、

1

前記分離手段により分離された第1および第2の光ビー ムをそれぞれ独立して受光する受光手段と、

前記受光手段の出力に基づいて、前記集光光学系の焦点 誤差並びに球面収差を検出する検出手段とを具備するこ とを特徴とする検出装置。

【請求項2】 前記受光手段は、前記第1の光ビームを 受光する第1受光部と、前記第2の光ビームを受光する 第2受光部とを有し、

前記検出手段は、前記第1または第2の受光部の出力に 基づき、前記第1または第2の光ビームの焦点誤差を検 出することを特徴とする請求項1記載の検出装置。

【請求項3】 前記分離手段はホログラムであることを 特徴とする請求項1または2のいずれかに記載の検出装 置。

【請求項4】 光源と、

前記光源から照射される光を記録媒体に集光させる集光 光学系と、

前記記録媒体に反射し、前記集光光学系を通過した光ビ ームを、前記光ビームの光軸に近い側の第1の光ビーム と、前記第1の光ビームよりも外側の第2の光ビームと に分離する分離手段と、

前記分離手段により分離された第1および第2の光ビー ムをそれぞれ独立して受光する受光手段と、

前記受光手段の出力に基づいて、前記集光光学系の焦点 誤差並びに球面収差を検出する検出手段と、

前記検出手段により検出された焦点誤差に基づき、前記 集光光学系の焦点誤差を補正する焦点誤差補正手段と、 前記検出手段により検出された球面収差に基づき、前記 集光光学系の球面収差を補正する収差補正手段とを具備 することを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項5】 前記受光手段は、前記第1の光ビームを 受光する第1受光部と、前記第2の光ビームを受光する 第2受光部とを有し、

前記検出手段は、前記第1または第2の受光部の出力に 基づき、前記第1または第2の光ビームの焦点誤差を検 40 出することを特徴とする請求項4記載の光ピックアップ 装置。

【請求項6】 前記分離手段はホログラムであることを 特徴とする請求項4または5のいずれかに記載の光ピッ クアップ装置。

【請求項7】 前記集光光学系は、少なくとも2つのレ ンズ要素が所定の間隔で配置された構造となっており、 前記収差補正手段は、前記検出手段により検出された球 面収差に基づいて、前記レンズ要素の間隔を調整するこ

する請求項4乃至6のいずれかに記載の光ピックアップ 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、集光光学系の焦点 誤差並びに球面収差を検出する検出装置及び光ピックア ップ装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、光ディスク装置において記録密 10 度を上げるためには、記録媒体である光ディスクの記録 再生に用いられる光の波長をできるだけ短くするか、光 ディスクに対して光を収束させる対物レンズの開口数 (NA)を大きくする必要がある。

【0003】ところで、光の波長を短くするには、より 波長の短いレーザ光を発生する半導体レーザを開発する 必要がある。しかしながら、このような半導体レーザを 開発するのは容易ではないことから、記録密度を上げる ために、通常、上記した対物レンズの開口数を大きくす る方法が採用されている。

【0004】一方、対物レンズの開口数を大きくするに 20 は、レンズの直径を大きくする方法が考えられるが、こ の場合、装置自体が大きなものとなる等の問題が生じ る。そこで、ソリッド・イマージョンレンズを用いて、 対物レンズの直径を大きくすることなく、対物レンズの 開口数を実効的に向上させる方法が検討されている。

【0005】例えば、特開平8-212579号公報に は、ソリッド・イマージョンレンズを用いた光ピックア ップ装置が開示されている。この光ピックアップ装置 は、図6に示すように、対物レンズ112により集光さ 30 れた光はプレート113とソリッド・イマージョンレン ズ114を介して光磁気ディスク111の基板111b を透過して情報記録層111aに集光され、該光磁気デ ィスク111を挟んでソリッド・イマージョンレンズ1 14と反対側に配置された磁気ヘッド115によって情 報の記録が行われる。

【0006】上記対物レンズ112は、周縁部において ホルダ118に保持されると共に、該ホルダ118の両 側部に対物レンズ112のフォーカス制御を行うための フォーカシングアクチュエータ119とトラッキング制 御を行うためのトラッキングアクチュエータ120とが 設けられている。

【0007】一方、上記ソリッド・イマージョンレンズ 114は、周縁部においてホルダ116に保持されると 共に、該ホルダ116の両側部にソリッド・イマージョ ンレンズ114とプレート113または対物レンズ11 2との間隔を調整するためのソリッド・イマージョンレ ンズアクチュエータ117が設けられている。

【0008】ここで、上記ソリッド・イマージョンレン ズ114は、光磁気ディスク111の基板1116とほ とで前記集光光学系の球面収差を補正することを特徴と 50 ぼ同じ屈折率を有するガラスでできており、半球面は集 光点を中心とする球面となっているので、対物レンズ1 12で集光された光の開口数は基板11116内において 屈折率倍される。具体的に述べると、対物レンズ112 の開口数を0.55、ソリッド・イマージョンレンズ1 14の屈折率を1.5とすると実効的な開口数は0.8 3となる。

【0009】このように、ソリッド・イマージョンレン ズ114を用いた集光光学系では、実効的な開口数が大 きくなるが、その分、光磁気ディスク111の基板11 1 b の厚み誤差や多層構造とした場合の基板 1 1 1 b の 10 厚みの変化により大きな球面収差が発生する。

【0010】したがって、上記のようにソリッド・イマ ージョンレンズ114と対物レンズ112とで構成され た集光光学系において、球面収差が発生した場合、ソリ ッド・イマージョンレンズアクチュエータ117を用い て、ソリッド・イマージョンレンズ114とプレート1 13または対物レンズ112との間隔を調整することに より、球面収差を補正するようになっている。

【0011】具体的には、ホルダ116とホルダ118 とに対向する電極をそれぞれ設け、該電極間の電気容量 20 を測定し、このときの電気容量が所定値となるように、 ホルダ116をソリッド・イマージョンレンズアクチュ エータ117によってホルダ118に対して移動させて 該ホルダ116とホルダ118との間隔を一定に保つこ とで、上記集光光学系の球面収差を疑似的に補正してい る。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した光 ピックアップ装置では、ホルダ116とホルダ118と の間の電気容量が所定値になるように、ホルダ116と 30 ホルダ118との間隔を一定に保つことで、集光光学系 の球面収差を補正するようになっている。

【0013】したがって、上記光ピックアップ装置で は、上記の電気容量を測定することで、集光光学系の球 面収差が検出されることになる。

【0014】しかしながら、ホルダ116とホルダ11 8との間で測定される電気容量は、10pF足らずの非 常に小さな値であるので、光ピックアップ装置内の配線 等の浮遊容量により誤差を生じる虞があり、このような 場合、集光光学系に生じる球面収差を精度良く検出する 40 ことができない。

【0015】このように、集光光学系に生じる球面収差 を精度良く検出できなければ、発生した球面収差を適切 に補正できず、この結果、光磁気ディスク111の情報 記録層111aに対する情報の記録および再生を適切に 行うことができないという問題が生じる。

【0016】本願発明は、上記の問題点に鑑みなされた ものであって、その目的は、周囲の電気的なノイズに影 響されることなく、集光光学系に生じる球面収差を精度 良く検出する検出装置を提供すると共に、該検出装置を 50

備えることで、集光光学系に生じる球面収差を適切に補 正することができ、光磁気ディスクに対する情報の記録 および再生を適切に行うことのできる光ピックアップ装 置を提供することにある。

[0017]

とを特徴とする。

【課題を解決するための手段】本発明の検出装置は、集 光光学系を通過した光ビームを、前記光ビームの光軸に 近い側の第1の光ビームと、前記第1の光ビームよりも 外側の第2の光ビームとに分離する分離手段と、前記分 離手段により分離された第1および第2の光ビームをそ れぞれ独立して受光する受光手段と、前記受光手段の出 力に基づいて、前記集光光学系の焦点誤差並びに球面収 差を検出する検出手段とを具備することを特徴とする。 【0018】さらに、前記受光手段は、前記第1の光ビ ームを受光する第1受光部と、前記第2の光ビームを受 光する第2受光部とを有し、前記検出手段は、前記第1 または第2の受光部の出力に基づき、前記第1または第 2の光ビームの焦点誤差を検出することを特徴とする。 【0019】また、前記分離手段はホログラムであるこ

【0020】本発明の光ピックアップ装置は、光源と、 前記光源から照射される光を記録媒体に集光させる集光 光学系と、前記記録媒体に反射し、前記集光光学系を通 過した光ビームを、前記光ビームの光軸に近い側の第1 の光ビームと、前記第1の光ビームよりも外側の第2の 光ビームとに分離する分離手段と、前記分離手段により 分離された第1および第2の光ビームをそれぞれ独立し て受光する受光手段と、前記受光手段の出力に基づい て、前記集光光学系の焦点誤差並びに球面収差を検出す る検出手段と、前記検出手段により検出された焦点誤差 に基づき、前記集光光学系の焦点誤差を補正する焦点誤 差補正手段と、前記検出手段により検出された球面収差 に基づき、前記集光光学系の球面収差を補正する収差補 正手段とを具備することを特徴とする。

【0021】さらに、前記受光手段は、前記第1の光ビ ームを受光する第1受光部と、前記第2の光ビームを受 光する第2受光部とを有し、前記検出手段は、前記第1 または第2の受光部の出力に基づき、前記第1または第 2の光ビームの焦点誤差を検出することを特徴とする。 【0022】また、前記分離手段はホログラムであるこ

【0023】また、前記集光光学系は、少なくとも2つ のレンズ要素が所定の間隔で配置された構造となってお り、前記収差補正手段は、前記検出手段により検出され た球面収差に基づいて、前記レンズ要素の間隔を調整す ることで前記集光光学系の球面収差を補正することを特 徴とする。

[0024]

とを特徴とする。

【発明の実施の形態】本発明の一実施の形態について図 1ないし図5に基づいて説明すれば、以下の通りであ

る。なお、本実施の形態では、集光光学系の球面収差を 検出する収差検出装置を備えた光ピックアップ装置を有 する光ディスク記録再生装置について説明する。

【0025】本実施の形態に係る光ディスク記録再生装 置は、図2に示すように、記録媒体である光磁気ディス ク6を回転駆動するスピンドルモータ9、光磁気ディス ク6に記録された情報を再生するための光ピックアップ 装置11、上記スピンドルモータ9および光ピックアッ プ装置11を駆動制御するための駆動制御部12、図示 しないが、光磁気ディスク6に情報を記録するための磁 10 気ヘッドを備えている。

【0026】上記光ピックアップ装置11は、半導体レ ーザ(光源)1、ホログラム2、コリメートレンズ3、 対物レンズ(レンズ要素)4およびソリッド・イマージ ョンレンズ (レンズ要素) 5からなる集光光学系10、 および光検出装置(検出手段) 7を有している。

【0027】また、集光光学系10とコリメートレンズ 3との間には、集光光学系10からの光ビームあるいは コリメートレンズ3からの光ビームの光路を約90°屈 折させるミラー8が配設されている。

【0028】さらに、上記対物レンズ4は、周縁部にお いてホルダ13により保持されており、このホルダ13 の外周部にはフォーカスアクチュエータ 14 が設けられ ている。このフォーカスアクチュエータ14により、対 物レンズ4を光軸方向に移動させるようになっている。 これにより、フォーカスアクチュエータ14を駆動制御 することで、対物レンズ4を適切な位置に移動させてフ オーカシング制御を行なうようになっている。

【0029】また、上記ソリッド・イマージョンレンズ 5は、周縁部においてホルダ15に保持されており、こ 30 のホルダ15の外周部にはソリッド・イマージョンレン ズアクチュエータ16が設けられている。このソリッド ・イマージョンレンズアクチュエータ16により、ソリ ッド・イマージョンレンズ5を光軸方向に移動させるよ うになっている。これにより、ソリッド・イマージョン レンズアクチュエータ16を駆動制御することで、ソリ ッド・イマージョンレンズ5と対物レンズ4との間隔を 調整し、集光光学系10で生じる球面収差を補正するよ うになっている。

【0030】上記駆動制御部12は、スピンドルモータ 40 9の駆動制御を行うスピンドルモータ駆動回路17、フ オーカスアクチュエータ14の駆動制御を行うフォーカ ス駆動回路18、ソリッド・イマージョンレンズアクチ ュエータ16の駆動制御を行うソリッド・イマージョン レンズ駆動回路19、上記のスピンドルモータ駆動回路 17、フォーカス駆動回路18、ソリッド・イマージョ ンレンズ駆動回路19への制御信号を生成するための制 御信号生成回路20、光検出装置7から得られた信号か ら情報を再生し、再生信号を生成するための情報再生回 路21からなる。

【0031】ここで、上記光ピックアップ装置11につ いて図1を参照しながら詳細に説明する。なお、説明の 便宜上、図1に示す光ピックアップ装置11では、図2 で示したミラー8については省略している。

【0032】上記光ピックアップ装置11において、ホ ログラム2、コリメートレンズ3、対物レンズ4および ソリッド・イマージョンレンズ5は、半導体レーザ1の 出射面と光磁気ディスク6の反射面との間に形成される 光軸OA上に配置され、光検出装置7はホログラム2の 回折光の焦点位置近傍に配置されている。

【0033】したがって、上記光ピックアップ装置11 において、半導体レーザ1から出射された光(以下、光 ビームと称する)は、ホログラム2で0次回折光として 透過し、コリメートレンズ3によって平行光に変換され た後、対物レンズ4およびソリッド・イマージョンレン ズ5を介して光磁気ディスク6上の所定の位置に集光さ れる。一方、光磁気ディスク6から反射された光ビーム は、ソリッド・イマージョンレンズ5、対物レンズ4、 コリメートレンズ3を通過してホログラム2に入射さ 20 れ、該ホログラム2にて回折されて光検出装置7上に集 光される。

【0034】上記ホログラム2は、光軸OAに直交する 直線CLと該光軸OAを中心とする第1の半円E1とで 囲まれた第1の領域2a、上記第1の半円E1と上記直 線CLと第1の半円E1よりも半径が大きく、且つ第1 の半円E1側の第2の半円E2と上記直線CLとで囲ま れた第2の領域2b、上記直線CLに対して第1の半円 E1および第2の半円E2とは反対側の第3の半円E3 と直線CLとで囲まれた第3の領域2cの3つの領域を 有している。

【0035】上記ホログラム2は、半導体レーザ1側か らの出射光を回折せずにそのまま光磁気ディスク6側に 透過させ、光磁気ディスク6側からの反射光を回折して 光検出装置7に導くようになっている。

【0036】そして、ホログラム2の各領域は、それぞ れの領域を光磁気ディスク6側から通過する光によって 各領域に対応する集光スポットが別々に形成されように 形成されている。これにより、ホログラム2の3つの領 域を光磁気ディスク6側から通過する光は、3箇所の集 光スポットを形成するようになる。

【0037】また、光検出装置7は、5つの光検出器7 a~7 e.で構成されている。光検出器(第1光検出器) 7 a ・光検出器 (第2光検出器) 7 b を並置して第1受 光部を形成し、光検出器(第3光検出器)7c・光検出 器(第4光検出器)7dを並置して第2受光部を形成 し、光検出器 7 e は単独で第3受光部を形成している。 【0038】したがって、上記ホログラム2の各領域で 回折された光ビームは、それぞれ光検出装置7の各受光

【0039】すなわち、光磁気ディスク6で反射された

部に導かれる。

١,"

光ビームの光軸OAに近い側の第1の光ビームとなる第 1の領域2aからの光ビームによって、第1受光部を構 成する光検出器7aと光検出器7bとの境界線上に集光 スポットP1が形成され、第1の光ビームよりも外側の 第2の光ビームとなる第2の領域2bからの光ビームに よって、第2受光部を構成する光検出器7cと光検出器 7 d との境界線上に集光スポット P 2 が形成され、光磁 気ディスク6の情報信号となる第3の領域2cからの光 ビームによって、第3受光部を構成する光検出器7 e に 集光スポットP3が形成されるようになっている。

【0040】また、上記の光検出器7a~7eは、いず れも受光した光(光信号)を電気信号に変換するように なっており、変換した電気信号を前述した制御信号生成 回路20および情報再生回路21に出力するようになっ ている。

【0041】したがって、光検出装置7の第1受光部の 光検出器7a・7bには、光磁気ディスク6で反射さ れ、ソリッド・イマージョンレンズ5および対物レンズ 4からなる集光光学系10を通過した光ビームのうち、 ホログラム 2 の光軸 O Aに近い側の第 1 の領域 2 a で回 2 0 一ムの焦点がずれた場合、光検出器 7 a \sim 7 e に形成さ 折される第1の光ビームが入射されるようになってい る。

【0042】また、光検出装置7の第2受光部の光検出 器7c・7dには、光磁気ディスク6で反射され、ソリ ッド・イマージョンレンズ5および対物レンズ4からな る集光光学系10を通過した光ビームのうち、ホログラ ム2の上記第1の領域2aよりも外側に形成された第2 の領域2bで回折される第2の光ビームが入射されるよ うになっている。

【0043】さらに、光検出装置7の第3受光部である 光検出器 7 e には、光磁気ディスク 6 で反射され、ソリ ッド・イマージョンレンズ5および対物レンズ4からな る集光光学系10を通過した光ビームが、ホログラム2 の第3の領域2cで回折され、入射されるようになって いる。

【0044】上記の各光検出器7a~7eにおいて、受 光された光信号は、それぞれ電気信号S1~S5に変換 される。

【0045】各光検出器7a~7eで得られた電気信号 は、図2に示す制御信号生成回路20に出力され、集光 40 光学系10における対物レンズ4やソリッド・イマージ ョンレンズ5の移動調整に使用される。

【0046】また、上記電気信号は、情報再生回路21 に出力され、再生信号に変換される。すなわち、光磁気 ディスク6に記録された情報信号(再生信号) RFは、 RF = S1 + S2 + S3 + S4 + S5で与えられる。

【0047】ここで、光磁気ディスク6の基板の厚さ や、ソリッド・イマージョンレンズ5と対物レンズ4と の相対位置等が適切で球面収差が発生していない状態に

いるとき、つまり、合焦時には、各光検出器7a~7e に形成される集光スポットP1~P3の形状は、図3 (b) に示すように、それぞれがほぼ同じ大きさの点と・ なる。

【0048】このとき、ホログラム2にて回折される光 ビームのうち、光軸OA側の第1の光ビームが合焦した 集光スポットP1は、光検出器7aと7bに対して照射 面積が等しくなるように形成される。つまり、光検出器 7 a から得られる電気信号S1と、光検出器7 b から得 られる電気信号S2との値が等しいことを示している。 【0049】ここで、光磁気ディスク6に照射される光 ビームの焦点誤差を示す焦点誤差信号FESは、

FES = S1 - S2

で表される。

10

【0050】したがって、上述のように光検出器7aと 7 b とで得られる電気信号 S 1 と S 2 との値が等しいと き、すなわち、合焦時には、焦点誤差信号FESはOと なっている。

【0051】また、光磁気ディスク6に照射される光ビ れる集光スポットP1~P3は半円状に拡がる。例えば 光磁気ディスク6が対物レンズ4から遠ざかる方向に移 動すると、図3(a)に示すように、集光スポットP1 は光検出器7b上に半円状に拡がる。これに対して、光 磁気ディスク6が対物レンズ4に近づく方向に移動する と、図3(c)に示すように、集光スポットP1は光検 出器7a上に半円状に拡がる。

【0052】すなわち、光磁気ディスク6が対物レンズ 4から遠ざかる方向に移動する場合には、光検出器 7 b により変換された電気信号S2の値の方が、光検出器7 aにより変換された電気信号S1の値よりも大きくな り、焦点誤差信号FESは負の値を示す。

【0053】一方、光磁気ディスク6が対物レンズ4に 近づく方向に移動する場合には、光検出器7aにより変 換された電気信号S1の値の方が、光検出器7bにより 変換された電気信号S2の値よりも大きくなり、焦点誤 差信号FESは正の値を示す。

【0054】したがって、上記焦点誤差信号FESを0 にするには、対物レンズ4を保持するホルダ13に設け られたフォーカスアクチュエータ14によって、該対物 レンズ4を光軸OA方向に移動させることにより行われ る。このときのフォーカス駆動回路18によるフォーカ スアクチュエータ14の駆動量は、光検出器7aと7b とで得られる電気信号S1とS2とに基づいて、制御信 号生成回路20で得られた制御信号によって調整され

【0055】一般に、光磁気ディスク6の基板の厚み や、ソリッド・イマージョンレンズ5と対物レンズ4と の相対位置等が適切でない場合には、上記構成の光ピッ おいて、該光磁気ディスク6上に正しく焦点が結ばれて 50 クアップ装置の集光光学系10において球面収差が発生 9

する。

【0056】この球面収差とは、集光光学系の中心部を 通過する光ビームの焦点と周辺部を通過する光ビームの 焦点とのずれを言う。

【0057】このように、集光光学系10において球面 収差が発生した場合、該集光光学系10において合焦状 態、すなわち光検出器7aと7bとの電気信号の差が0 である状態であっても、例えば図4 (a) や図4 (c) に示すように、光検出器7cと7dとの電気信号の差が 0でなく、正あるいは負の値をとるようになる。これに 10 より、正あるいは負の球面収差が発生したことが示され

【0058】例えば球面収差のない状態、且つ合焦状態 では、集光光学系10を構成するソリッド・イマージョ ンレンズ5および対物レンズ4を通過する全ての光ビー ムは、図5(b)に示すように、光軸OA上の光磁気デ ィスク6の一点に集光される。このときの光検出装置7 における各光ビームの集光スポットP1~P3の形状 は、図4(b)に示すようになる。

【0059】これに対して、上記集光光学系10に正あ 20 るいは負の球面収差が発生した場合には、上記集光光学 系10を通過する光ビームは、図5(a)および図5

(c) に示すように、光磁気ディスク6の一点に集光さ れない。ここでは、光軸OAに近い側の光ビームの焦点 位置が光磁気ディスク6上の適切な位置にあることを前 提とし、例えば、集光光学系10において正の球面収差 が発生した場合、図5 (a) に示すように、該集光光学 系10の周辺部の光ビームの焦点位置が光軸OAに近い 側の光ビームの焦点位置よりもソリッド・イマージョン レンズ5から遠くになる。一方、集光光学系10におい 30 て負の球面収差が発生した場合、図5(c)に示すよう に、該集光光学系10の周辺部の光ビームの焦点位置が 光軸OAに近い側の光ビームの焦点位置よりもソリッド ・イマージョンレンズ5に近くなる。

【0060】したがって、焦点誤差信号FESが0とな るようにフォーカスアクチュエータ14により対物レン ズ4が駆動された状態において、光磁気ディスク6の基 板の厚みが所定寸法と異なる寸法であるため、例えば正 の球面収差が生じたとすると、集光光学系10の周辺部 の光ビームは光磁気ディスク6がソリッド・イマージョ 40 ンレンズ5に近づいたときと同様な変化を示すので光検 出器7c・7dの集光スポットP2の形状は、図4

(c) に示すように、光検出器7c上に半ドーナッツ状 に拡がる。

【0061】逆に、負の球面収差が生じたとすると、集 光光学系10の周辺部の光ビームは光磁気ディスク6が ソリッド・イマージョンレンズ5から遠ざかったときと 同様な変化を示すので光検出器7 c・7 dの集光スポッ トP2の形状は、図4 (a) に示すように、光検出器7 d 上に半ドーナッツ状に拡がる。

10

【0062】したがって、焦点誤差信号FESが0で保 たれている場合、集光光学系10で発生した球面収差を 示す信号である球面収差信号SAは、各光検出器7a~ 7 eから得られる電気信号S1~S5を用いて示せば以 下のようになる。

【0063】SA=S3-S4また、焦点誤差信号FE Sが0で保たれない場合、この焦点誤差信号FESを考 慮して、球面収差信号SAは以下のようになる。

[0064]

 $SA = (S3 - S4) - (S1 - S2) \times K$ (K は定数である)

上記の球面収差信号SAは、制御信号生成回路20で生 成され、ソリッド・イマージョンレンズ駆動回路19に 出力される。

【0065】したがって、ソリッド・イマージョンレン ズ駆動回路19は、上記球面収差信号SAに基づいて、 ソリッド・イマージョンレンズ5を保持しているホルダ 15の外周部に設けられたソリッド・イマージョンレン ズアクチュエータ16を駆動制御して、球面収差を補正 するようになっている。

【0066】つまり、ソリッド・イマージョンレンズ駆 動回路19は、球面収差信号SAが正の球面収差を示す とき、ソリッド・イマージョンレンズ5と対物レンズ4 との間隔を長くする方向に、ソリッド・イマージョンレ ンズアクチュエータ16を駆動制御し、逆に球面収差信 号SAが負の球面収差を示すとき、ソリッド・イマージ ョンレンズ5と対物レンズ4との間隔を短くする方向 に、ソリッド・イマージョンレンズアクチュエータ16 を駆動制御するようになっている。

【0067】このように、球面収差信号SAに基づい て、集光光学系10で発生する球面収差がなくなるよう 補正すれば、情報の再生を行う場合、光磁気ディスク6 に記録された情報の再生を良好に行うことができる。ま た、情報の記録を行う場合、図示しない磁気ヘッドを光 磁気ディスク6を挟んで光ピックアップ装置11とは反 対側に配置すれば、該光磁気ディスク6への情報の書き 込みも良好に行うことができる。

【0068】また、上記球面収差の補正は、光磁気ディ スク6を光記録再生装置に装着した時に行っても良い し、光磁気ディスク6を光記録再生装置に装着した後、 情報の記録あるいは再生を行っている間に適宜行っても

【0069】つまり、例えば、半導体レーザ1によっ て、光検出装置 7 による集光光学系 1 0 の球面収差検出 後の球面収差情報を上記光磁気ディスク6の所定領域に 記録するようにする。すなわち、半導体レーザ1は、光 検出装置7による集光光学系10の球面収差検出後、光 磁気ディスク6の装着時にのみ該光磁気ディスク6の所 定領域に球面収差情報を記録する。

【0070】例えば、光磁気ディスク6の基板厚みのば

12

らつきが一枚のディスク内で一定値以内に抑えられている場合には、光磁気ディスク6の交換時の最初に球面収差検出を行なって、半導体レーザ1によって球面収差情報を光磁気ディスク6の所定の領域に記録し、この球面収差情報に従って、ソリッド・イマージョンレンズ5と対物レンズ4との間隔を調整し、その後はこのレンズ間隔を保つようにすれば良い。この場合、光磁気ディスク6の交換時のみ集光光学系10の球面収差の補正を行なうことになる。また、半導体レーザ1は、光磁気ディスク6の所定領域に球面収差情報を記録する収差情報記録 10手段の機能を兼ねている。

【0071】一方、光磁気ディスク6の基板厚みのばらっきが一枚のディスク内で大きなばらつきがある場合には、記録および再生中に常に収差量を検出し、ソリッド・イマージョンレンズ5と対物レンズ4との間隔を変えて球面収差の補正を行う。この場合、光磁気ディスク6の記録および再生時に常に集光光学系10の球面収差の補正を行うことになる。このとき、集光光学系10の球面収差の検出は、光磁気ディスク6に対する情報の記録あるいは再生中に常に行なわれるようになるので、検出20した球面収差情報は光磁気ディスク6に記録しないようにする。

【0072】以上のように、光磁気ディスク6の交換時のみ集光光学系10の球面収差の補正を行う場合には、補正の時間は多少長くかかっても良いので、集光光学系10の対物レンズ4とソリッド・イマージョンレンズ5とのレンズ間隔を調整するソリッド・イマージョンレンズアクチュエータ16は低速動作のものが使用できる。これにより、球面収差の補正が行なえる光ピックアップ装置を安価に製造することができる。

【0073】一方、光磁気ディスク6の記録再生時に常に集光光学系10の球面収差の補正を行なう場合には、光磁気ディスク6の回転速度に応じた速度で反応する高速のソリッド・イマージョンレンズアクチュエータ16が必要となるが、ディスク厚さの製造公差を大きくとれるので、光磁気ディスク6の製造コストを低減することが可能となる。

【0074】なお、本実施の形態では、光磁気ディスク6に反射した光ビームを光検出装置7に導くための手段として、ホログラム2を使用したが、これに限定される40ものではなく、例えば、ビームスプリッタと半円形あるいは半ドーナッツ形に分割されたウェッジプリズムを組み合わせたものを使用しても良い。しかしながら、装置の小型化を図る点からは、ホログラム2を使用するのが好ましい。

【0075】また、焦点誤差信号FESを決定するために、集光光学系10を通過した光ビームのうち、光軸OAに近い側の光ビーム (第1の光ビーム) が光検出装置7において合焦するか否かで行なっていたが、これに限定されるものではなく、集光光学系10を通過した光ビ 50

ームのうち、該集光光学系10の周縁部の光ビーム (第2の光ビーム)が光検出装置7において合焦するか否かで行なっても良い。しかしながら、集光光学系10の周縁部の光ビームである第2光ビームは球面収差の影響を受け易く、焦点位置を精密に調整し難いので、光軸OAに近い側の光ビームである第1の光ビームを用いて焦点誤差を調整することが好ましい。

【0076】さらに、本実施の形態では、対物レンズ4とソリッド・イマージョンレンズ5とを組み合わせた集 光光学系10の球面収差の検出および収差補正について 述べたが、本願発明は、これに限定されるものではない。例えば、複数のレンズ要素を組み合わせた集光光学 系にも適用可能である。

[0077]

【発明の効果】本発明によれば、集光光学系に発生する 球面収差を光学的に検出することが可能になり、従来の ように、集光光学系に発生する球面収差を電気的に検出 する装置に比べて、周囲の電気的なノイズに影響され ず、精度良く球面収差を検出することができる。

【0078】このように、集光光学系の球面収差が精度 良く検出できれば、該集光光学系の球面収差の補正を適 切に行なうことができるという効果を奏する。

【0079】また、記録媒体に対して情報の記録あるいは再生を適切に行なうことができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ピックアップ装置の概略構成図である。

【図2】図1に示す光ピックアップ装置を備えた光ディ 30 スク記録再生装置の概略構成図である。

【図3】(a)~(c)は、図1に示す光ピックアップ 装置における光ビームの焦点がずれた場合の光検出器上 での集光スポットの形状変化を示す説明図である。

【図4】(a)~(c)は、図1に示す光ピックアップ 装置が有する集光光学系で球面収差が生じた場合の光検 出器上での集光スポットの形状変化を示す説明図であ る

【図5】(a)~(c)は、図1に示す光ピックアップ 装置が有する集光光学系で発生する球面収差を示す説明 図である。

【図6】従来の光ピックアップ装置の概略構成図である。

【符号の説明】

- 1 半導体レーザ (光源、収差情報記録手段)
- 2 ホログラム
- 2 a 第1の領域
- 2 b 第2の領域
- 4 対物レンズ (レンズ要素)
- 5 ソリッド・イマージョンレンズ (レンズ要素)
- 6 光磁気ディスク (記録媒体)

(8) 寺開 2 0 0 2 - 3 9 9 1 5 (P 2 0 0 2 - 3 9 9 1 5 A)

14

16 ソリッド・イマージョンレンズアクチュエータ (収差補正手段)

CL 直線

E1 第1の半円

E2 第2の半円

OA 光軸

10 集光光学系

光検出装置

7 a 光検出器 (第1光検出器)

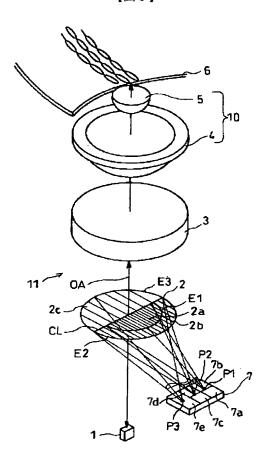
7 b 光検出器 (第2光検出器)

7 c 光検出器 (第3光検出器)

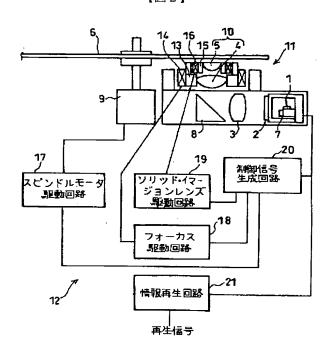
7 d 光検出器 (第4光検出器)

7

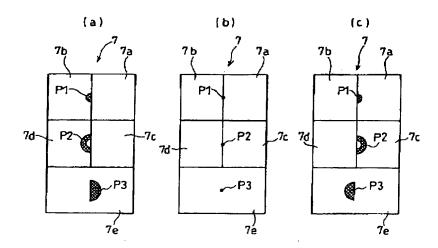
【図1】



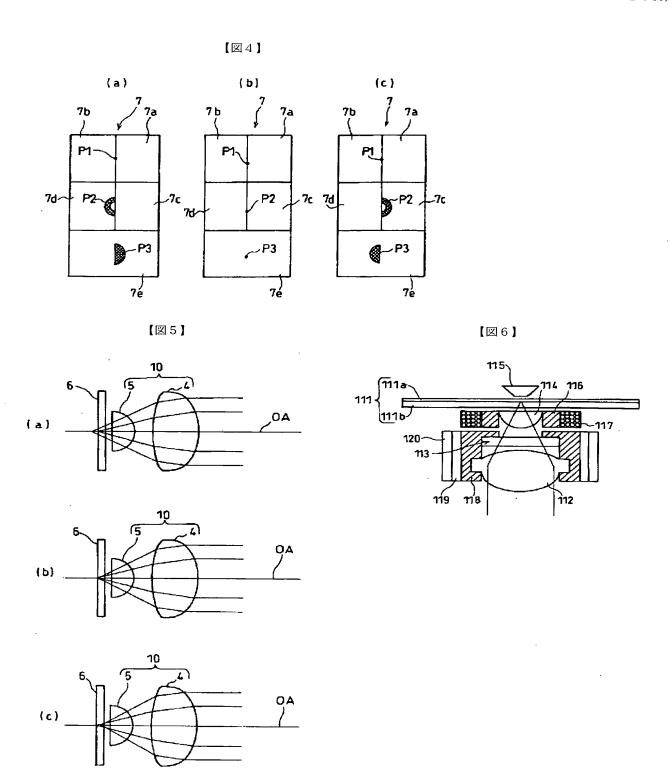
【図2】



【図3】







フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷
G 1 1 B 11/105

識別記号 551

G 1 1 B 11/105

FΙ

551L 5D119

テーマコード(参考)

5 5 1 N

(10) 引用 2 0 0 2 - 3 9 9 1 5 (P 2 0 0 2 - 3 9 9 1 5 A)

5 5 6

G 0 2 B 7/11

5 5 6 B N

L

Fターム(参考) 2G086 HH01 HH06

2H051 AA14 BA49 BA70 CB02 CB07

CB11 CB14 CB19 CC02 CD12

2H087 KA13 LA01 NA09 PA02 PA17

PB02 QA33

5D075 CD16 CD17 CE03

5D118 AA14 BB06 CD02 DA20 DB21

5D119 AA09 AA21 AA28 BA01 BB05

EA03 EC01 JA24 JA49 LB12